

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION  
(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing:

31 August 2000 (31.08.00)

International application No.:

PCT/JP00/01029

Applicant's or agent's file reference:

E4866-00

International filing date:

23 February 2000 (23.02.00)

Priority date:

24 February 1999 (24.02.99)

Applicant:

KAWAMURA, Satoshi et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

25 July 2000 (25.07.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



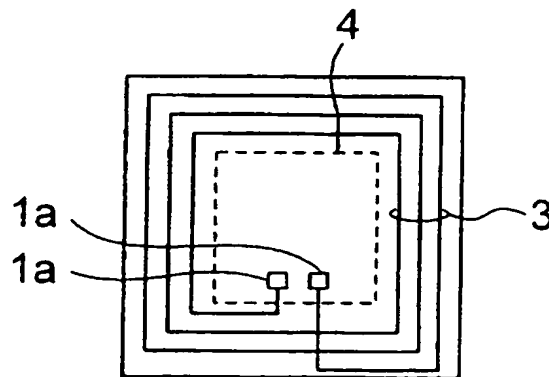
PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類7 H01L 25/00</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/51181</p> <p>(43) 国際公開日 2000年8月31日(31.08.00)</p>						
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP00/01029</p> <p>(22) 国際出願日 2000年2月23日(23.02.00)</p> <p>(30) 優先権データ</p> <table border="0"> <tr> <td>特願平11/46545</td> <td>1999年2月24日(24.02.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/59753</td> <td>1999年3月8日(08.03.99)</td> <td>JP</td> </tr> </table> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日立マクセル株式会社(HITACHI MAXELL, LTD.)(JP/JP] 〒567-8567 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 Osaka, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および</p> <p>(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ) 川村哲士(KAWAMURA, Satoshi)(JP/JP] 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-28F1202 Kanagawa, (JP)</p> <p>清水 伸(SHIMIZU, Shin)(JP/JP] 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町141 アークヒルズ304 Kanagawa, (JP)</p> <p>(74) 代理人 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.) 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル331 Tokyo, (JP)</p>		特願平11/46545	1999年2月24日(24.02.99)	JP	特願平11/59753	1999年3月8日(08.03.99)	JP	<p>(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
特願平11/46545	1999年2月24日(24.02.99)	JP						
特願平11/59753	1999年3月8日(08.03.99)	JP						

(54)Title: IC DEVICE AND ITS PRODUCTION METHOD, AND INFORMATION CARRIER MOUNTED WITH IC DEVICE AND ITS PRODUCTION METHOD

(54)発明の名称 IC素子及びその製造方法並びにIC素子を搭載した情報担体及びその製造方法



(57) Abstract

An information carrier mounted with an IC device which in integral with a coil and having a long communication range and its production method, and a structure of an IC device preferable to this type of information carrier and its production method. The IC device includes a conductor constituting a coil (3) and having a multilayer structure comprising a metal sputter layer or metal vapor deposition layer (6) and a metal plating layer (7). The method for producing such an IC device comprises forming a metal plating layer (7) by precision electrocasting. The information carrier includes an IC device (1) disposed at the planar center of a base (21). The method for producing such an information carrier comprises mounting a required part including an IC device one of bandlike bases (41 to 45), and punching the bandlike base to produce one of required information carriers (20a to 20h).

# (57)要約

コイルが一体形成された I C 素子が搭載された通信距離がより大きな情報担体とその製造方法と、この種の情報担体に好適な I C 素子の構成とその製造方法。

I C 素子については、コイル 3 を構成する導体を、金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 と金属めっき層 7 とを有する多層構造にした。I C 素子の製造方法については、金属めっき層 7 の形成手段として、精密電鍍法を用いた。情報担体については、基体 2 1 の平面方向の中心部に I C 素子 1 を配置するという構成にした。情報担体の製造方法については、帯状素材 4 1 ~ 4 5 のいずれかに I C 素子を含む所要の搭載部品が搭載されたものを作製し、次いで、この帯状素材から所要の情報担体 2 0 a ~ 2 0 h を打ち抜き形成するという構成にした。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AG	アンティグア・バーブーダ	DZ	アルジェリア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AL	アルバニア	EE	エストニア	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AU	オーストラリア	FR	フランス	LS	レソト	SK	スロヴァキア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GE	グルジア	MA	モロッコ	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR	トルコ
BY	ベラルーシ	GW	ギニア・ビサオ		共和国	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TZ	タンザニア
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	UG	ウガンダ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	US	米国
CI	コートジボアール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CM	カメルーン	IN	インド	MZ	モザンビーク	VN	ヴェトナム
CN	中国	IS	アイスランド	NE	ニジェール	YU	ユーゴスラヴィア
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NL	オランダ	ZA	南アフリカ共和国
CU	キューバ	JP	日本	NO	ノルウェー	ZW	ジンバブエ
CY	キプロス	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド		
CZ	チェコ	KG	キルギスタン	PL	ポーランド		
DE	ドイツ	KP	北朝鮮	PT	ポルトガル		
DK	デンマーク	KR	韓国	RO	ルーマニア		

## 明 細 書

I C素子及びその製造方法並びに I C素子を搭載した情報担体及びその製造方法

## 5 技術分野

本発明は、チップ上にコイルが一体形成された I C素子と、当該 I C素子の製造方法と、当該 I C素子を搭載した情報担体と、当該情報担体の製造方法とに関する。

## 背景技術

- 10 従来より、所定形状の基体内に I C素子と当該 I C素子の端子部に電氣的に接続されたアンテナコイルとを備え、リーダライタからの電力の受給及びリーダライタとの間の信号の送受信を電磁波を用いて非接触で行う非接触式の情報担体が知られている。この種の情報担体としては、その外形により、カード形、コイン形又はボタン形などがある。
- 15 従来、この種の情報担体としては、アンテナコイルを基体にパターン形成したもの、或いは、巻線からなるアンテナコイルを基体に担持したものが用いられているが、近年に至って、アンテナコイルと I C素子との接続点の保護処理や防湿対策が不要で安価に作成できること、及び基体に曲げやねじれ等のストレスが作用した場合にもコイルに断線を生じることがなく耐久性に優れることから、 I C
- 20 素子自体にアンテナコイルが一体形成された I C素子を基体に搭載したものが提案されている。

I C素子にアンテナコイルを形成する方法としては、スパッタ法が用いられており、 I C素子に一体形成されたアンテナコイルの導体は、アルミニウムのスパッタ膜から構成されている。

- 25 ところで、アンテナコイルを I C素子に一体形成すると、アンテナコイルを基体にパターン形成したり、巻線からなるアンテナコイルを基体に担持する場合に比べて、コイルの巻径や導体幅が小さくなり、巻数についても自ずと限界があるため、リーダライタとの間の通信距離を大きくすることが困難になる又は、通信距離を確保することができない。

- 本発明は、かかる従来技術の不備を解消するためになされたものであって、アンテナコイルが一体形成された I C 素子を搭載してなる情報担体であって、通信距離がより大きな情報担体とその製造方法を提供すること、及び、この種の情報担体に好適なアンテナコイルが一体形成された I C 素子の構成とその製造方法と
- 5 を提供することを技術的な課題とするものである。

#### 発明の開示

##### 〈I C 素子〉

- 本発明は、前記の課題を達成するため、I C 素子については、コイルが一体形成された I C 素子において、前記コイルを構成する導体を、金属スパッタ層又は
- 10 金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造にした。

- 金属めっき層は、金属スパッタ層や金属蒸着層に比べて電気抵抗値が小さいので、コイルの導体を金属スパッタ層又は金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造にすると、単に金属スパッタ層のみ又は金属蒸着層のみから構成した場合に比べて電磁エネルギーの損失を小さくすることができ、リーダライタとの間の通
- 15 信距離を大きくすることができる。

##### 〈I C 素子の製造方法〉

- 本発明は、前記の課題を達成するため、I C 素子の製造方法については、第 1 に、所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上に金属スパッタ層又は金属蒸着層を均一に形成する工程と、当該金属スパッタ層又は金属蒸着層
- 20 上にフォトリソ層を均一に形成する工程と、前記フォトリソ層にコイルを含む所要のパターンを露光し、現像後、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を前記所定のパターンで露出させる工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層の露出部分に無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鍍法を用いて金属め
- 25 っき層を積層する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトリソ層を除去する工程と、前記金属めっき層より露出した前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を選択的にエッチングし、前記所定のパターンに相当する所定の導電パターンを形成する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要の I C 素子を得る工程とを含む構成とした。

また、第 2 に、所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上に

- フォトレジスト層を均一に形成する工程と、前記フォトレジスト層にコイルを含む所要のパターンを露光し、現像後、前記表面保護膜を前記所定のパターンで露出させる工程と、現像処理後の完成ウエハをスパッタ装置又は真空蒸着装置に装着し、前記表面保護膜の露出部分に金属スパッタ層又は金属蒸着層を形成する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトレジスト層を除去する工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層に無電解めっき法又は電気めっき法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のＩＣ素子を得る工程とを含む構成とした。

- かように、完成ウエハにコイルを含む所要の導電パターンを形成し、しかる後に完成ウエハをスクライビングして所要のＩＣ素子を得ると、個々のＩＣ素子にコイルを形成する場合に比べてコイルが一体形成されたＩＣ素子を高能率に製造でき、その製造コストを低減することができる。また、ウエハに形成された全てのＩＣ素子に対して均一の厚みのコイルを高精度で形成することが可能となり、通信特性のばらつきを少なくすることが可能となる。

- また、個々のＩＣ素子についてスパッタ法又は真空蒸着法及びメッキ法を用いてコイルを形成すると、ＩＣ素子の外周部に不要の導体が付着してＩＣ素子の絶縁性が問題になるが、完成ウエハにコイルを含む所要の導電パターンを形成した場合には、スパッタ時等において完成ウエハの外周部に不要の導体が付着しても、該部は不要部分としてもともと処分されるべき部分であるので、個々のＩＣ素子の絶縁性が問題になることもない。

#### 〈情報担体〉

本発明は、前記の課題を達成するため、情報担体については、アンテナコイルが一体形成されたＩＣ素子を基体に搭載してなる情報担体において、前記ＩＣ素子を前記基体の平面方向の中心部に配置するという構成にした。

- かように、ＩＣ素子を基体の平面方向の中心部に配置すると、ＩＣ素子に一体形成されたコイルとリーダライタに備えられたアンテナコイルの中心を合致させやすくなるので、両コイル間の電磁結合係数を大きくすることができ、リーダライタから情報担体への電力の供給及びリーダライタと情報担体との間の信号の送受信を確実に行うことができる。特に、情報担体を構成する基体の形状を、円形

や正方形それに正多角形など、リーダライタに対する方向性がないか、リーダライタに対する方向性が少ない形状にした場合には、I C素子に一体形成されたコイルとリーダライタに備えられたアンテナコイルの中心をより合致させやすくなるので、より使用が容易な情報担体とすることができる。

5 〈情報担体の製造方法〉

本発明は、前記の課題を達成するため、情報担体の製造方法については、第1に、I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設された第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、コイルが一体形成されたI C素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第1乃至第3の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むという構成にした。

第2に、I C素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設され、かつ、当該各透孔の周囲にリング状の凹部が同心円状に形成された第1帯状素材の前記凹部内に前記I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1帯状素材の片面に透孔を有しない第2帯状素材を接合する工程と、コイルが一体形成されたI C素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第3帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第1乃至第3の帯状素材を一体に打ち抜いて前記I C素子及び当該I C素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むという構成にした。

かように、帯状素材に所要のI C素子（又はI C素子とコイル）が搭載されたものを作製し、しかる後にこの帯状素材から所要の情報担体を打ち抜き形成するようにすると、同一の情報担体を高能率に製造することができるので、所要の情報担体の製造コストを低減することができる。

なお、前記第1及び第2の製造方法においては、情報担体の基体を3部材（第1乃至第3の帯状素材）で形成したが、第1帯状素材にI C素子を収納するための透孔を開設する構成に代えて、第1帯状素材にI C素子を収納するための凹部を形成することにより、情報担体の基体を2部材で形成することもできる。

また、前記第 1 及び第 2 の製造方法においては、I C 素子（又は I C 素子とコイル）を带状素材内に完全に埋設したが、带状素材に開設された透孔又は带状素材に形成された凹部内に I C 素子（又は I C 素子とコイル）を収納した後、前記透孔又は凹部を樹脂封止することによって、I C 素子（又は I C 素子とコイル）

5 を带状素材の片面に露出させることもできる。

さらに、I C 素子（又は I C 素子とコイル）を带状素材の片面に露出させる場合には、带状素材に I C 素子（又は I C 素子とコイル）を収納するための凹部を形成することにより、情報担体の基体を 1 部材で形成することもできる。

図面の簡単な説明

10 図 1 A, 1 B, 1 C は実施形態例に係る I C 素子の平面図である。

図 2 A, 2 B は実施形態例に係る I C 素子の要部断面図である。

図 3 は、完成ウエハの平面図である。

図 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F は、本発明に係る I C 素子製造方法の第 1 例を示す工程図である。

15 図 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E は、本発明に係る I C 素子製造方法の第 2 例を示す工程図である。

図 6 は、アンテナコイルを含む所要の導電パターンが形成された完成ウエハの平面図である。

図 7 は、第 1 実施形態例に係る情報担体の一部切断した平面図である。

20 図 8 は、第 1 実施形態例に係る情報担体の分解斜視図である。

図 9 は、第 1 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 0 は、第 1 実施形態例に係る情報担体の使用状態の説明図である。

図 1 1 は、第 2 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 2 は、第 3 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

25 図 1 3 は、第 4 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 4 は、第 5 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 5 は、第 6 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 6 は、第 7 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 7 は、第 8 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

図 1 8 は、帯状素材の第 1 例を示す部分斜視図である。

図 1 9 は、帯状素材の第 2 例を示す部分斜視図である。

図 2 0 は、帯状素材の第 3 例を示す部分斜視図である。

図 2 1 は、帯状素材の第 4 例を示す部分斜視図である。

5 図 2 2 は、帯状素材の第 5 例を示す部分斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

〈I C 素子〉

以下、本発明に係る I C 素子の実施形態例を、図 1 A, 1 B, 1 C 及び図 2 A, 2 B に基づいて説明する。図 1 A, 1 B, 1 C は実施形態例に係る I C 素子の平

10 面図、図 2 A, 2 B は実施形態例に係る I C 素子の要部断面図である。

本実施形態例に係る I C 素子は、図 1 A, 1 B, 1 C 及び図 2 A, 2 B に示すように、I C 素子 1 の入出力端子 1 a の形成面側に、酸化シリコン膜や樹脂膜等の絶縁性の表面保護膜 2 を介して、矩形スパイラル形状のアンテナコイル 3 を一体に形成してなる。

15 図 1 A の I C 素子 1 は、回路形成部 4 を除く外周部にのみアンテナコイル 3 を形成したものであって、I C 素子 1 に形成された回路とアンテナコイル 3 との間における浮遊容量の発生を防止することができ、リーダライタからの電力の受給効率及びリーダライタとの間の信号の送受信効率を高めることができる。

図 1 B の I C 素子 1 は、回路形成部 4 と対向する部分までアンテナコイル 3 を  
20 形成したものであって、コイルの巻数を多くできることから、リーダライタからの電力の受給効率及びリーダライタとの間の信号の送受信効率を高めることができる。

尚、図 1 B の実施例においては回路形成部 4 の一部にアンテナコイルが重なるものとしたが、I C 素子を小型・低コストにするために回路形成部 4 上に全ての  
25 アンテナコイルを形成することも可能である。

図 1 C の I C 素子 1 は、矩形スパイラル形状に形成されたアンテナコイル 3 の角の部分に斜めに面取りしたものであって、角部における電流集中を防止してアンテナコイル 3 の抵抗値を低減することができ、リーダライタからの電力の受給効率及びリーダライタとの間の信号の送受信効率を高めることができる。面取り

の形状は円弧状にしても同様の効果を得ることができる。また、面取りは各線の内周側及び外周側の双方に施すことが好ましいが、外周側にのみ施した場合にも効果がある。

いずれの場合にも、実用上十分な電力の供給を受け、かつ、リーダライタとの間の通信特性を確保するためには、前記アンテナコイル3の線幅を7  $\mu$ m以上、線間距離を5  $\mu$ m以下、巻数を20ターン以上とすることが好ましい。

IC素子1の入出力端子1aとアンテナコイル3との接続は、表面保護膜2に開設された透孔5を介して行われる。この場合、アンテナコイル3の形成位置が若干ずれた場合にも、入出力端子1aとアンテナコイル3との接続が確実に行われるように、図2A、2Bに示す如く、透孔5の直径又は幅をアンテナコイル3の線幅よりも小さくすることがより好ましい。

アンテナコイル3を構成する導体は、図2A、2Bに示すように、金属スパッタ層又は金属蒸着層6と金属めっき層7を含む多層構造になっている。図2Aは、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の上面にのみ金属めっき層7を形成した例であり、図2Bは、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の周面全体に金属めっき層7を形成した例を示している。前記金属スパッタ層又は金属蒸着層6及び金属めっき層7は、任意の導電性金属をもって形成することができるが、比較的安価で導電率が高いことから、金属スパッタ層又は金属蒸着層6についてはアルミニウム又はニッケル又は銅若しくはクロムで形成することが好ましく、図2A、図2Bに示すように、単層もしくは、複数の組合わせからなる積層とすることができる。前記金属めっき層7は、銅で形成することが好ましく、無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鍍法により形成することができる。

#### 〈IC素子の製造方法〉

次に、本発明に係るIC素子製造方法の実施形態例を、図3乃至図6に基づいて説明する。図3は所定のプロセス処理を経て完成されたいわゆる完成ウエハの平面図、図4A、4B、4C、4D、4E、4Fは本発明に係るIC素子製造方法の第1例を示す工程図、図5A、5B、5C、5D、5Eは本発明に係るIC素子製造方法の第2例を示す工程図、図6はアンテナコイルを含む所要の導電パターンが形成された完成ウエハの平面図である。

図3に示すように、完成ウエハ11には、最外周部を除く内周部分に多数個のIC素子用の回路12が等間隔に形成されており、その回路形成面側には、所要の表面保護膜2が形成されている（図4及び図5参照）。

- 図4A、4B、4C、4D、4E、4Fに示す第1実施形態例に係るIC素子
- 5 製造方法では、まず図4Aに示すように、完成ウエハ11の回路形成面の表面保護膜2の上に、アルミニウム又はアルミニウム合金若しくは銅又は銅合金を用いて、金属スパッタ層又は金属蒸着層6を均一に形成する。次いで、図4Bに示すように、当該金属スパッタ層又は金属蒸着層6上にフォトレジスト層12を均一に形成し、形成されたフォトレジスト層12にコイルを含む所要のパターンが形
- 10 成されたマスク13を被せ、マスク13の外側から所定波長の光14を照射してフォトレジスト層12を露光する。しかる後に露光されたフォトレジスト層12の現像処理を行い、図4Cに示すように、フォトレジスト層12の露光部分を除去して、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層6の前記露光パターンと対応する部分を露出させる。金属スパッタ層又は金属蒸着層6の露出パターンには、図6に
- 15 示すように、リング状の電極部15と、前記各回路12と対向する部分に形成されたアンテナコイル3と、これら電極部15と各アンテナコイル3とを連結するリード部16とが含まれる。次いで、前記電極部15を一方の電極として、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の露出部分に電気めっき又は精密電鍍を施し、図4Dに示すように、金属スパッタ層又は金属蒸着層6の露出部分に金属めっき層7
- 20 を積層する。次いで、完成ウエハ11の表面に付着したフォトレジスト層12をアッシング処理等によって除去し、図4Eに示すように、均一な金属スパッタ層又は金属蒸着層6上に電極部15とアンテナコイル3とリード部16とを有する金属めっき層7が形成された完成ウエハ11を得る。次いで、金属めっき層7より露出した金属スパッタ層又は金属蒸着層6を選択的にエッチングし、図4Fに
- 25 示すように、金属めっき層7より露出した金属スパッタ層又は金属蒸着層6を除去する。これによって、金属スパッタ層又は金属蒸着層6と金属めっき層7とが共に図6に示す所要の導電パターンに形成された完成ウエハ11が得られる。最後に、前記完成ウエハ11をスクライビングして、図1に示す所要のIC素子1を得る。

なお、前記実施形態例においては、金属めっき層 7 の形成手段として電気めっき法又は精密電鍍法を用いたが、かかる構成に代えて、無電解めっき法を用いて前記金属めっき層 7 を形成することもできる。この場合には、金属めっき層 7 の形成に電極を必要としないので、フォトレジスト層 1 2 の露光に際して、電極部 5 1 5 の形成とリード部 1 6 の形成が不要になる。

無電解めっきは、化学めっきとも呼ばれ、素地金属をめっき金属の金属塩溶液中に浸して金属イオンを素地表面に析出させるもので、比較的簡単な設備で密着力が強く均一で十分な厚みを有するめっき層が得られるという特徴がある。前記金属塩は、めっきする金属イオンの供給源となるものであり、銅をめっきする場合 10 には、硫酸銅、塩化第二銅、硝酸銅等の溶液がめっき液として用いられる。銅などの金属イオンは、素地となる金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 上にのみに析出し、絶縁性の表面保護層 2 上には析出しない。素地材は、めっき金属イオンに対してイオン化傾向が小さく、かつ、めっき金属イオンの析出に対する触媒作用をもつ必要がある。このため、アルミニウムからなる金属スパッタ層又は金属蒸 15 着層 6 上に銅をめっきする場合には、アルミニウム層の表面にニッケルを数  $\mu\text{m}$  以下の厚さに形成し、硝酸亜鉛液に数秒間浸して亜鉛に置換する前処理を施すことが好ましい。

一方、電気めっき法及び精密電鍍法は、めっき金属のイオンを含むめっき浴中に金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 が形成された完成ウエハ 1 1 とめっき金属か 20 らなる電極とを浸漬し、完成ウエハ 1 1 に形成された金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 を陰極、めっき浴中に浸漬された電極を陽極として電圧を印加し、めっき浴中の金属イオンを金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 の表面に析出させる方法である。電気めっき法及び精密電鍍法も、銅をめっきする場合には、硫酸銅、塩化第二銅、硝酸銅等の溶液がめっき液として用いられる。

25 本例の IC 素子製造方法は、完成ウエハ 1 1 にコイルを含む所要の導電パターンを形成し、しかる後に完成ウエハ 1 1 をスクライビングして所要の IC 素子 1 を得るという構成にしたので、個々の IC 素子にコイルを形成する場合に比べてコイルが一体形成された IC 素子を高能率に製造でき、その製造コストを低減することができる。また、ウエハに形成された全ての IC 素子に対して均一の厚み

のコイルを高精度で形成することが可能となり、通信特性のばらつきを少なくすることができる。また、個々の IC 素子についてスパッタ法又は真空蒸着法及びメッキ法を用いてコイルを形成すると、IC 素子の外周部に不要の導体が付着して IC 素子の絶縁性が問題になるが、完成ウエハ 11 にコイルを含む所要の導電

5 パターンを形成した場合には、スパッタ時等において完成ウエハ 11 の外周部に不要の導体が付着しても、該部は不要部分としてもともと処分されるべき部分であるので、個々の IC 素子の絶縁性に悪影響を与えることもない。さらに、本例の IC 素子製造方法は、フォトリジスト層 12 がある状態で金属めっき層 7 の形成を行い、しかる後に、金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 の金属めっき層 7 が積

10 層されていない部分をエッチングによって除去するようにしたので、図 2 A に示すように、金属めっき層 7 が金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 の上面にのみ積層され、幅方向に広がらないので、精密なアンテナコイル 3 を形成することができ、狭い面積内に巻数の多いアンテナコイル 3 を形成することができる。

一方、図 5 に示す第 2 実施形態例に係る IC 素子製造方法では、図 5 A に示す

15 ように、完成ウエハ 11 に形成された表面保護膜 2 上にフォトリジスト層 12 を均一に形成し、形成されたフォトリジスト層 12 にコイルを含む所要のパターンが形成されたマスク 13 を被せ、マスク 13 の外側から所定波長の光 14 を照射してフォトリジスト層 12 を露光する。しかる後に露光されたフォトリジスト層 12 の現像処理を行い、図 5 B に示すように、フォトリジスト層 12 の露光部分

20 を除去して、表面保護膜 2 の前記露光パターンと対応する部分を露出させる。フォトリジスト層 12 の露光パターンは、図 6 に示すように、電極部 15 とアンテナコイル 3 とリード部 16 とを含む形状にすることができる。次いで、現像処理後の完成ウエハ 11 をスパッタ装置又は真空蒸着装置に装着し、図 5 C に示すように、前記表面保護膜 2 の露出部分に金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 を形成す

25 る。次いで、図 5 D に示すように、完成ウエハ 11 に付着したフォトリジスト層 12 をアッシング処理等によって除去した後、電極部 15 を一方の電極として、金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 に電気めっきを施し、図 5 E に示すように、金属スパッタ層又は金属蒸着層 6 の露出部分に金属めっき層 7 を積層する。最後に、前記完成ウエハ 11 をスクライビングして、図 1 に示す所要の IC 素子 1 を得る。

なお、前記実施形態例においては、金属めっき層 7 の形成手段として電気めっき法を用いたが、かかる構成に代えて、無電解めっき法を用いて前記金属めっき層 7 を形成することもできる。この場合には、金属めっき層 7 の形成に電極を必要としないので、フォトリソ層 1 2 の露光に際して、電極部 1 5 の形成とリード部 1 6 の形成が不要になる。

本例の IC 素子製造方法は、前記第 1 実施形態例に係る IC 素子製造方法と同様の効果を有するほか、完成ウエハ 1 1 に導電パターンを形成するための工程数を少なくできるので、アンテナコイルが一体形成された IC 素子をより高能率に製造することができる。

#### 10 〈情報担体〉

以下、本発明に係る情報担体の実施形態例を、図 7 乃至図 1 7 に基づいて説明する。図 7 は第 1 実施形態例に係る情報担体の一部切断した平面図、図 8 は第 1 実施形態例に係る情報担体の分解斜視図、図 9 は第 1 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 0 は第 1 実施形態例に係る情報担体の使用状態の説明図、図 1 1 は第 2 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 2 は第 3 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 3 は第 4 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 4 は第 5 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 5 は第 6 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 6 は第 7 実施形態例に係る情報担体の断面図、図 1 7 は第 8 実施形態例に係る情報担体の断面図である。

20 第 1 実施形態例に係る情報担体 2 0 a は、図 7 乃至図 9 に示すように、平面形状が円形に形成されたコイン形の基体 2 1 と、当該基体 2 1 の平面方向及び厚さ方向の中心部に設定された IC 素子 1 とからなる。IC 素子 1 としては、図 1 及び図 2 に示すように、アンテナコイルが一体形成されたものが用いられる。

25 基体 2 1 は、図 8 及び図 9 に示すように、上部材 2 2 と中間部材 2 3 と下部材 2 4 とから構成されており、それぞれ接着剤層 2 5 を介して一体に接合されている。基体 2 1 を構成する各部材 2 2, 2 3, 2 4 は、紙材又はプラスチックシートをもって形成することができるが、廃棄後に自然分解し、焼却しても有蓋ガスの発生量が少なく、価格的にも安価であることから、紙材をもって作製することが特に好ましい。また、前記各部材 2 2, 2 3, 2 4 の 1 つ又は 2 つを紙材にて

形成し、他の1つ又は2つをプラスチックシートにて形成することももちろん可能である。

前記中間部材23の中央部には、IC素子1を内挿可能な透孔27が開設されており、前記各部材22、23、24を接合することによって形成される空間内にIC素子1が収納される。なお、IC素子1は、取扱時の動揺を防止するために下部材24に接着することが好ましい。この場合、下部材24の片面に接着剤層25を均一に形成しておき、この接着剤層25を利用して中間部材23と下部材24との接着と、下部材24とIC素子1との接着を行うようにすることが、コスト上有利である。また、透孔27の平面形状は任意の形状とすることができるが、中間部材23と下部材24とを接合することによって形成される凹部にIC素子1を収納する際、当該凹部とIC素子1の回転方向の向きを厳密に合わせる必要がないことから、図7及び図8に示すように、円形の透孔27を形成する方法が製造上有利である。

本例の情報担体20aは、IC素子1を円形に形成された基体21の平面方向の中心部に配置したので、図10に示すように、略半円形のスロット101と当該スロット101における円弧部の中心に備えられた非接触通信用のアンテナコイル102とを有するリーダライタ100の前記スロット101内に情報担体20を挿入することによって、自動的にIC素子1に一体形成されたアンテナコイル3とリーダライタ100に備えられたアンテナコイル102の心出しを行うことができ、両コイル3、102間の電磁結合係数を大きくできることから、リーダライタ100から情報担体20への電力の供給及びリーダライタ100と情報担体20との間の信号の送受信を確実に行うことができる。また、情報担体20aの平面形状を円形に形成したので、略半円形に形成されたスロット101に対する方向性がなく、使用の容易性に優れる。さらに、IC素子1を基体21内に完全に収納したので、IC素子1の保護効果が高く耐久性に優れると共に、該部からIC素子1が見えないので、美観にも優れる。

第2実施形態例に係る情報担体20bは、図11に示すように、上部材22と中間部材23と下部材24との3部材をもって基体21を構成すると共に、IC素子1の周囲にブースタコイル28を同心円状に配置したことを特徴とする。図

- 中の符号 29 はブースタコイル 28 を収納するための凹部を示しており、この凹部 29 は中間部材 23 の透孔 27 の周囲にリング状に形成される。その他の構成については、前記第 1 実施例に係る情報担体 20 a と同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体 20 b は、第 1 実施形態例に係る情報担体 20 a と同様の効果を有するほか、IC 素子 1 の周囲にブースタコイル 28 を同心円状に配置したので、IC 素子 1 に一体形成されたアンテナコイル 3 とリーダライタ 100 に備えられたアンテナコイル 102 との電磁結合をブースタコイル 28 を介することによってより高いものとすることができ、より一層の電力供給の安定化及び信号送受信の安定化又は通信距離の増加を図ることができる。
- 10 第 3 実施形態例に係る情報担体 20 c は、図 12 に示すように、上部材 22 と下部材 24 との 2 部材をもって基体 21 を構成し、下部材 24 に IC 素子 1 を収納するための凹部 30 を形成したことを特徴とする。その他の構成については、前記第 1 実施例に係る情報担体 20 a と同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体 20 c は、第 1 実施形態例に係る情報担体 20 a
- 15 と同様の効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ることができる。
- 第 4 実施形態例に係る情報担体 20 d は、図 13 に示すように、上部材 22 と下部材 24 との 2 部材をもって基体 21 を構成し、下部材 24 に IC 素子 1 を収納するための第 1 凹部 30 とブースタコイル 28 を収納するための第 2 凹部 29
- 20 を形成したことを特徴とする。その他の構成については、前記第 3 実施例に係る情報担体 20 c と同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体 20 c は、第 2 実施形態例に係る情報担体 20 b と同様の効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ることができる。
- 25 第 5 実施形態例に係る情報担体 20 e は、図 14 に示すように、IC 素子収納用の透孔 27 が開設された上部材 22 と当該透孔 27 を有しない下部材 24 との 2 部材をもって基体 21 を構成し、上部材 22 と下部材 24 とを接合することによって形成される凹部内に IC 素子 1 を収納し、当該凹部内をポッティング樹脂 31 で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第 1 実施例に

係る情報担体 20 a と同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体 20 e は、IC 素子 1 が基体をもって被覆されない点を除いて、第 1 実施形態例に係る情報担体 20 a と同様の効果を有する。

第 6 実施形態例に係る情報担体 20 f は、図 15 に示すように、IC 素子収納用の透孔 27 が開設されると共に当該透孔 27 の周囲にブースタコイル収納用の凹部 29 が同心に形成された上部材 22 と、前記透孔 27 及び凹部 29 を有しない下部材 24 との 2 部材をもって基体 21 を構成し、前記凹部 29 内にブースタコイル 28 を収納して当該凹部 29 内をポッティング樹脂 31 で封止すると共に、上部材 22 と下部材 24 とを接合することによって形成される凹部内に IC 素子 1 を収納して当該凹部内をポッティング樹脂 31 で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第 5 実施例に係る情報担体 20 e と同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体 20 f は、IC 素子 1 が基体をもって被覆されない点を除いて、第 1 実施形態例に係る情報担体 20 a と同様の効果を有する。

第 7 実施形態例に係る情報担体 20 g は、図 16 に示すように、片面に IC 素子 1 を収納するための凹部 30 が形成された 1 部材をもって基体 21 を構成し、前記凹部 30 内に IC 素子 1 を収納して当該凹部 30 内をポッティング樹脂 31 で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第 5 実施例に係る情報担体 20 e と同じであるので、重複を避けるために説明を省略する。本例の情報担体 20 g は、第 5 実施形態例に係る情報担体 20 e と同様の効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ることができる。

第 8 実施形態例に係る情報担体 20 h は、図 17 に示すように、片面に IC 素子 1 を収納するための第 1 凹部 30 とブースタコイル 28 を収納するための第 2 凹部 29 が形成された 1 部材をもって基体 21 を構成し、前記第 1 凹部 30 内に IC 素子 1 を収納して当該凹部 30 内をポッティング樹脂 31 で封止すると共に、前記第 2 凹部 29 内にブースタコイル 28 を収納して当該凹部 29 内をポッティング樹脂 31 で封止したことを特徴とする。その他の構成については、前記第 7 実施例に係る情報担体 20 g と同じであるので、重複を避けるために説明を省略

する。本例の情報担体 20h は、第 6 実施形態例に係る情報担体 20f と同様の効果を有するほか、部品点数が少ないことから、情報担体のより一層の低コスト化を図ることができる。

5      なお、前記各実施形態例においては、基体 21 の平面形状を円形に形成したが、その他、正方形、長方形、三角形又は多角形など、任意の形状に形成することができる。

10      なお、前記第 2、第 4、第 6、第 8 実施形態例に係る情報担体においては、独立したブースターコイル 28 を基体 21 の透孔部および凹部に設置したが、基体 21 を構成する部材に印刷・メッキ・スパッタ等によりブースターコイル 28 を直接形成することも可能である。

またブースターコイル 28 を、IC 素子と非接触通信を行なう第 1 のコイルと外部リーダライタと通信を行なう第 1 のコイルより大きな第 2 のコイルを直列に接続した構成とすることで、通信距離を伸ばすことも可能である。

#### 〈情報担体の製造方法〉

15      次に、本発明に係る情報担体製造方法の実施形態例を、図 18 乃至図 22 に基づいて説明する。図 18 は本発明に係る情報担体の製造に使用される帯状素材の第 1 例を示す部分斜視図、図 19 は帯状素材の第 2 例を示す部分斜視図、図 20 は帯状素材の第 3 例を示す部分斜視図、図 21 は帯状素材の第 4 例を示す部分斜視図、図 22 は帯状素材の第 5 例を示す部分斜視図である。

20      本発明の情報担体製造方法は、帯状に形成された 1 つの基体構成用の素材（帯状素材）に IC 素子 1 を含む所要の搭載部品を設定し、次いで、必要に応じて、当該帯状素材の片面又は両面に他の帯状素材を接合するか搭載部品のポッティングを行い、しかる後に、単体の若しくは接合された帯状素材から所要の情報担体を打ち抜き形成することを特徴とする。本発明に係る情報担体製造方法の実施に  
25      は、図 18 に示すように IC 素子 1 を収納するための透孔 27 が一定間隔で開設された帯状素材 41、図 19 に示すように IC 素子 1 を収納するための透孔 27 が一定間隔で開設されると共に各透孔 27 の周囲にブースタコイル 28 を収納するためのリング状の凹部 29 が同心に形成され、当該リング状の凹部 29 の底面に接着剤層 32 が塗布された帯状素材 42、図 20 に示すように IC 素子 1 を収

納するための凹部 30 が一定間隔で開設され、当該凹部 30 の底面に接着剤層 32 が塗布された帯状素材 43、図 21 に示すように IC 素子 1 を収納するための第 1 凹部 30 が一定間隔で開設されると共に各第 1 凹部 30 の周囲にブースタコイル 28 を収納するためのリング状の第 2 凹部 29 が同心に形成され、これら各凹部 29、30 の底面に接着剤層 32 が塗布された帯状素材 44、図 22 に示すように透孔や凹部を有さず片面に接着剤層 25 が均一に塗布帯状素材 45 が選択的に用いられる。

本発明に係る情報担体製造方法の第 1 例は、第 1 実施形態例に係る情報担体 20a を製造するためのものであって、図 18 に示した 1 枚の帯状素材 41 と図 22 に示した 2 枚の帯状素材 45 を用いる。そして、まず帯状素材 41 の片面に接着剤層 25 を介して帯状素材 45 を接合し、IC 素子 1 を収納可能な空間を有する帯状部材 41、45 の接合体を得る。次いで、前記空間内に IC 素子 1 を位置決めして収納し、接着剤層 25 を介して帯状素材 45 に接着する。次いで、帯状素材 41 の他面側にもう 1 枚の帯状素材 45 を接着剤層 25 を介して接合し、内部空間内に IC 素子 1 が収納された帯状部材 41、45 の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第 1 実施形態例に係る情報担体 20a を得る。本例の情報担体製造方法は、帯状素材 41、45 に多数の IC 素子 1 をケーシングし、しかる後にこの帯状素材 41、45 から所要の情報担体を打ち抜き形成するので、同一の情報担体を高能率に製造することができ、情報担体の製造コストを低減することができる。

本発明に係る情報担体製造方法の第 2 例は、第 2 実施形態例に係る情報担体 20b を製造するためのものであって、図 19 に示した 1 枚の帯状素材 42 と図 22 に示した 2 枚の帯状素材 45 を用いる。そして、まず帯状素材 42 に形成されたリング状の凹部 29 内にブースタコイル 28 を収納し、接着剤層 32 を介して当該凹部 29 の底面に接着する。次いで、帯状素材 42 の片面に接着剤層 25 を介して帯状素材 45 を接合し、IC 素子 1 を収納可能な空間を有する帯状部材 42、45 の接合体を得る。次いで、前記空間内に IC 素子 1 を位置決めして収納し、接着剤層 25 を介して帯状素材 45 に接着する。次いで、帯状素材 41 の他面側にもう 1 枚の帯状素材 45 を接着剤層 25 を介して接合し、内部空間内に IC

C素子1が収納された帯状部材42, 45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第2実施形態例に係る情報担体20bを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

- 5 本発明に係る情報担体製造方法の第3例は、第3実施形態例に係る情報担体20cを製造するためのものであって、図20に示した1枚の帯状素材43と図22に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材43に形成された凹部30内にIC素子1を位置決めして収納し、接着剤層32を介して当該凹部30の底面に接着する。次いで、帯状素材43の凹部形成面側に帯状素材45
- 10 を接着剤層25を介して接合し、内部空間内にIC素子1が収納された帯状部材43, 45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第3実施形態例に係る情報担体20cを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

- 本発明に係る情報担体製造方法の第4例は、第4実施形態例に係る情報担体20dを製造するためのものであって、図21に示した1枚の帯状素材44と図22に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材44に形成された第1凹部30内にIC素子1を位置決めして収納し、接着剤層32を介して当該凹部30の底面に接着すると共に、当該帯状素材44に形成されたリング状の第2凹部29内にブースタコイル28を収納し、接着剤層32を介して当該凹部
- 20 29の底面に接着する。次いで、帯状素材44の凹部形成面側に帯状素材45を接着剤層25を介して接合し、内部空間内にIC素子1が収納された帯状部材44, 45の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第3実施形態例に係る情報担体20cを得る。本例の情報担体製造方法も、第1実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

- 25 本発明に係る情報担体製造方法の第5例は、第5実施形態例に係る情報担体20eを製造するためのものであって、図18に示した1枚の帯状素材41と図22に示した1枚の帯状素材45を用いる。そして、まず帯状素材41の片面に接着剤層25を介して帯状素材45を接合し、IC素子1を収納可能な空間を有する帯状部材41, 45の接合体を得る。次いで、前記空間内にIC素子1を位置

決めして収納し、接着剤層 2 5 を介して带状素材 4 5 に接着する。次いで、前記 I C 素子 1 が収納された空間内にポッティング樹脂 3 1 を充填し、I C 素子 1 が設定された带状部材 4 1, 4 5 の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第 5 実施形態例に係る情報担体 2 0 e を得る。本例の情報担体製造方法も、第 1 実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第 6 例は、第 6 実施形態例に係る情報担体 2 0 f を製造するためのものであって、図 1 9 に示した 1 枚の带状素材 4 2 と図 2 2 に示した 1 枚の带状素材 4 5 を用いる。そして、まず带状素材 4 2 に形成されたリング状の凹部 2 9 内にブースタコイル 2 8 を収納し、接着剤層 3 2 を介して  
10 当該凹部 2 9 の底面に接着する。次いで、带状素材 4 2 の片面に带状素材 4 5 を接着剤層 2 5 を介して接合し、I C 素子 1 を収納可能な空間を有する带状部材 4 2, 4 5 の接合体を得る。次いで、前記空間内に I C 素子 1 を位置決めして収納し、接着剤層 2 5 を介して带状素材 4 5 に接着する。次いで、前記ブースタコイル 2 8 が収納された凹部 2 9 内と前記 I C 素子 1 が収納された空間内にポッティング樹脂 3 1 を充填し、I C 素子 1 及びブースタコイル 2 8 が設定された带状部材 4 2, 4 5 の接合体を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第 6 実施形態例に係る情報担体 2 0 f を得る。本例の情報担体製造方法も、第 1 実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第 7 例は、第 7 実施形態例に係る情報担体 2 0 g を製造するためのものであって、図 2 0 に示した 1 枚の带状素材 4 3 を用いる。そして、まず带状素材 4 3 に形成された凹部 3 0 内に I C 素子 1 を位置決めして収納し、接着剤層 3 2 を介して当該凹部 3 0 の底面に接着する。次いで、前記 I C 素子 1 が収納された凹部 3 0 内にポッティング樹脂 3 1 を充填し、I C 素子 1 が設定された带状部材 4 3 を得る。最後に、この带状部材 4 3 を所定の形状  
25 に切断して、第 7 実施形態例に係る情報担体 2 0 g を得る。本例の情報担体製造方法も、第 1 実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

本発明に係る情報担体製造方法の第 8 例は、第 8 実施形態例に係る情報担体 2 0 h を製造するためのものであって、図 2 1 に示した 1 枚の带状素材 4 4 を用いる。そして、まず带状素材 4 4 に形成された第 1 凹部 3 0 内に I C 素子 1 を位置

決めして収納し、接着剤層 32 を介して当該凹部 30 の底面に接着すると共に、当該帯状素材 44 に形成されたリング状の第 2 凹部 29 内にブースタコイル 28 を収納し、接着剤層 32 を介して当該凹部 29 の底面に接着する。次いで、前記 IC 素子 1 が収納された第 1 凹部 30 内及び前記ブースタコイル 28 が収納され  
5 た第 2 凹部 29 内にポッティング樹脂 31 を充填し、IC 素子 1 及びブースタコイル 28 が設定された帯状部材 43 を得る。最後に、この接合体を所定の形状に切断して、第 8 実施形態例に係る情報担体 20h を得る。本例の情報担体製造方法も、第 1 実施形態例に係る情報担体製造方法と同様の効果を有する。

なお、前記第 2、第 4、第 6、第 8 実施形態例においては、ブースタコイル 2  
10 8 を基体 21 と独立の別体に形成したが、基体 21 を構成するいずれかの帯状部材に印刷形成することもできる。

#### 産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明の IC 素子は、IC 素子と一体に形成されるコイルの導体を金属スパッタ層又は金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造に  
15 したので、当該導体を単に金属スパッタ層のみ又は金属蒸着層のみから構成した場合に比べて電磁エネルギーの損失を小さくすることができ、リーダライタからの受給電力の安定化、リーダライタとの間の通信の安定化、及びリーダライタとの間の通信距離の拡大を図ることができる。

本発明の IC 素子製造方法は、個々の IC 素子にコイルを形成するのではなく、  
20 完成ウエハに個々の IC 素子に応じた多数のコイルを同時に形成するので、コイルが一体形成された IC 素子を高能率に製造することができ、この種の IC 素子の低コスト化を図ることができる。

本発明の情報担体は、コイルが一体形成された IC 素子を基体の平面方向の中心部に配置したので、IC 素子に一体形成されたコイルとリーダライタに備えら  
25 れたアンテナコイルの中心を容易に合致させることができ、両コイル間の電磁結合係数を大きくすることができるので、リーダライタから情報担体への電力の供給及びリーダライタと情報担体との間の信号の送受信を安定化できる。

本発明の情報担体製造方法は、帯状素材に IC 素子を含む所要の搭載部品が搭載されたものを作製し、しかる後にこの帯状素材から所要の情報担体を打ち抜き

形成するようにしたので、同一の情報担体を高能率に製造することができ、I C素子を備えた情報担体の製造コストを低減することができる。

## 請求の範囲

1. 外部とのデータ通信を非接触で行なうためのコイルが一体形成された I C 素子において、前記コイルを構成する導体を、金属スパッタ層又は金属蒸着層と
- 5 金属めっき層とを有する多層構造にしたことを特徴とする I C 素子。
2. 請求項 1 に記載の I C 素子において、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層をアルミニウム・ニッケル・銅・クロムのうちの少なくとも 1 つの金属又はこれらを含む合金で形成し、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層の上に前記金属めっきを銅で形成したことを特徴とする I C 素子。
- 10 3. 請求項 1 に記載の I C 素子において、絶縁性の表面保護膜を介して前記 I C 素子の入出力端子形成面側に前記コイルを形成し、前記 I C 素子の入出力端子と前記コイルとを、前記表面保護膜に開設された前記コイルの線幅よりも小径の透孔を介して電氣的に接続したことを特徴とする I C 素子。
4. 請求項 1 に記載の I C 素子において、前記コイルの平面形状を矩形スパイ
- 15 ラル形状とし、角部の全部又は一部に面取りを施したことを特徴とする I C 素子。
5. 請求項 1 に記載の I C 素子において、前記金属めっき層を、無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鍍法により形成したことを特徴とする I C 素子。
6. 請求項 1 に記載の I C 素子において、前記コイルの線幅を  $7\ \mu\text{m}$  以上、線
- 20 間距離を  $5\ \mu\text{m}$  以下、巻数を 20 ターン以上としたことを特徴とする I C 素子。
7. 所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上に金属スパッタ層又は金属蒸着層を均一に形成する工程と、当該金属スパッタ層又は金属蒸着層上にフォトリソ層を均一に形成する工程と、前記フォトリソ層に外部とのデータ通信を非接触で行なうためのコイルを含む所要のパターンを露光・現
- 25 像することで前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を前記所定のパターンで露出させる工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層の露出部分に無電解めっき法又は電気めっき法若しくは精密電鍍法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトリソ層を除去する工程と、前記金属めっき層より露出した前記金属スパッタ層又は金属蒸着層を選択的にエッチングし、前記

所定のパターンに相当する所定の導電パターンを形成する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のＩＣ素子を得る工程とを含むことを特徴とするＩＣ素子の製造方法。

8. 所定のプロセスを経て作製された完成ウエハの表面保護膜上にフォトレジスト層を均一に形成する工程と、前記フォトレジスト層に外部とのデータ通信を非接触で行なうためのコイルを含む所要のパターンを露光・現像することで、前記表面保護膜を前記所定のパターンで露出させる工程と、現像処理後の完成ウエハをスパッタ装置又は真空蒸着装置に装着し、前記表面保護膜の露出部分に金属スパッタ層又は金属蒸着層を形成する工程と、前記完成ウエハに付着したフォトレジスト層を除去する工程と、前記金属スパッタ層又は金属蒸着層に無電解めっき法又は電気めっき法を用いて金属めっき層を積層する工程と、前記完成ウエハをスクライビングしてコイルが一体形成された所要のＩＣ素子を得る工程とを含むことを特徴とするＩＣ素子の製造方法。
- 5
- 10

9. 外部とのデータ通信を非接触で行なうためのアンテナコイルが一体形成されたＩＣ素子を基体に搭載してなる情報担体において、前記ＩＣ素子を前記基体の平面方向の中心部に配置したことを特徴とする情報担体。
- 15

10. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記ＩＣ素子の表裏両面側を前記基体にて覆ったことを特徴とする情報担体。

11. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記ＩＣ素子の片面側のみを前記基体にて覆ったことを特徴とする情報担体。
- 20

12. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記基体の平面形状を、円形又は正方形に形成したことを特徴とする情報担体。

13. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記基体の全部又は一部を紙にて形成したことを特徴とする情報担体。

14. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記基体を上部材と下部材と中間部材とからなる 3 層の貼り合わせ構造とし、前記中間部材の中央部に開設された透孔内に前記ＩＣ素子を収納したことを特徴とする情報担体。
- 25

15. 請求項 14 に記載の情報担体において、前記透孔の平面形状を円形にしたことを特徴とする情報担体。

16. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記基体を上部材と下部材とからなる 2 層の貼り合わせ構造とし、前記上部材又は下部材の中央部に形成された凹部内に前記 IC 素子を収納したことを特徴とする情報担体。

17. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記基体を単層構造とし、前記基体の中央部に形成された凹部内に前記 IC 素子を収納したことを特徴とする情報担体。

18. 請求項 16 又は請求項 17 に記載の情報担体において、前記凹部の平面形状を円形にしたことを特徴とする情報担体。

19. 請求項 9 に記載の情報担体において、前記基体内に、前記 IC 素子と独立の別体に形成された他のコイルを備えたことを特徴とする情報担体。

20. IC 素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設された第 1 帯状素材と透孔を有しない第 2 帯状素材とを接合する工程と、コイルが一体形成された IC 素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第 1 帯状素材と透孔を有しない第 3 帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第 1 乃至第 3 の帯状素材を一体に打ち抜いて前記 IC 素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

21. IC 素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設され、かつ、当該各透孔の周囲にリング状の凹部が同心円状に形成された第 1 帯状素材の前記凹部内に前記 IC 素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第 1 帯状素材の片面に透孔を有しない第 2 帯状素材を接合する工程と、コイルが一体形成された IC 素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記第 1 帯状素材と透孔を有しない第 3 帯状素材とを接合する工程と、接合された前記第 1 乃至第 3 の帯状素材を一体に打ち抜いて前記 IC 素子及び当該 IC 素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

22. IC 素子を挿入可能な多数の凹部が規則的に形成された第 1 帯状素材の前記凹部内にコイルが一体形成された IC 素子を収納して固定する工程と、前記第 1 帯状素材の凹部形成面側に透孔を有しない第 2 帯状素材を接合する工程と、接合された前記第 1 及び第 2 の帯状素材を一体に打ち抜いて前記 IC 素子を有する

所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

23. IC素子を挿入可能な多数の第1凹部が規則的に形成され、かつ、当該各第1凹部の周囲にリング状の第2凹部が同心円状に形成された第1帯状素材の前記第1凹部内にコイルが一体形成されたIC素子を収納して固定する工程と、前記第1帯状素材の第2凹部内に前記IC素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1帯状素材の凹部形成面側に透孔を有しない第2帯状素材を接合する工程と、接合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記IC素子及び当該IC素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

24. IC素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設された第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、コイルが一体形成されたIC素子を前記透孔内に収納して固定する工程と、前記IC素子が収納された前記透孔を樹脂封止する工程と、接合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記IC素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

25. IC素子を挿入可能な多数の透孔が規則的に開設され、かつ、当該各透孔の周囲にリング状の凹部が同心円状に形成された第1帯状素材の前記凹部内に前記IC素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1帯状素材と透孔を有しない第2帯状素材とを接合する工程と、前記コイルが収納された前記透孔を樹脂封止する工程と、接合された前記第1及び第2の帯状素材を一体に打ち抜いて前記IC素子及び当該IC素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

26. IC素子を挿入可能な多数の凹部が規則的に形成された帯状素材の前記凹部内にコイルが一体形成されたIC素子を収納して固定する工程と、前記IC素子が収納された前記凹部を樹脂封止する工程と、前記帯状素材を打ち抜いて前記IC素子を有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。

27. IC素子を挿入可能な多数の第1凹部が規則的に形成され、かつ、当該各第1凹部の周囲にリング状の第2凹部が同心円状に形成された帯状素材の前記第1凹部内にコイルが一体形成されたIC素子を収納して固定する工程と、前記帯状部材の第2凹部内に前記IC素子とは独立の別体に形成されたコイルを収納して固定する工程と、前記第1及び第二の凹部を樹脂封止する工程と、前記帯状素材を打ち抜いて前記IC素子及び当該IC素子とは独立の別体に形成されたコイルを有する所要の情報担体を得る工程とを含むことを特徴とする情報担体の製造方法。
- 5

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

1 / 10

FIG. 1A

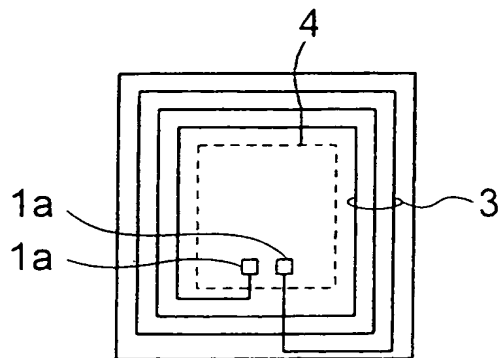


FIG. 1B

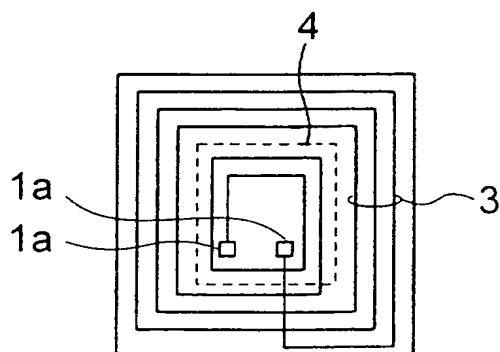
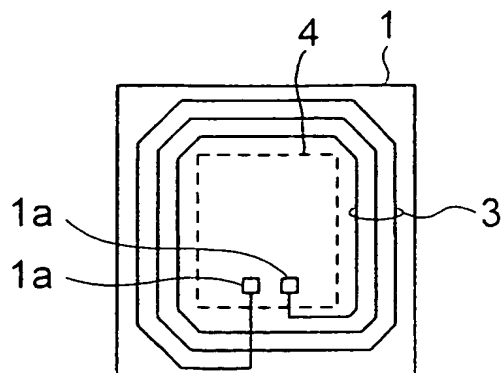


FIG. 1C



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

FIG. 2 A

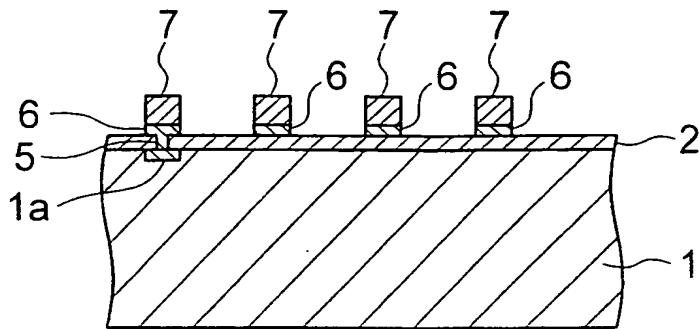


FIG. 2 B

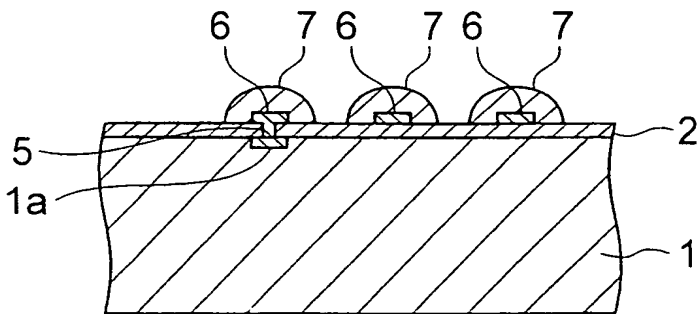
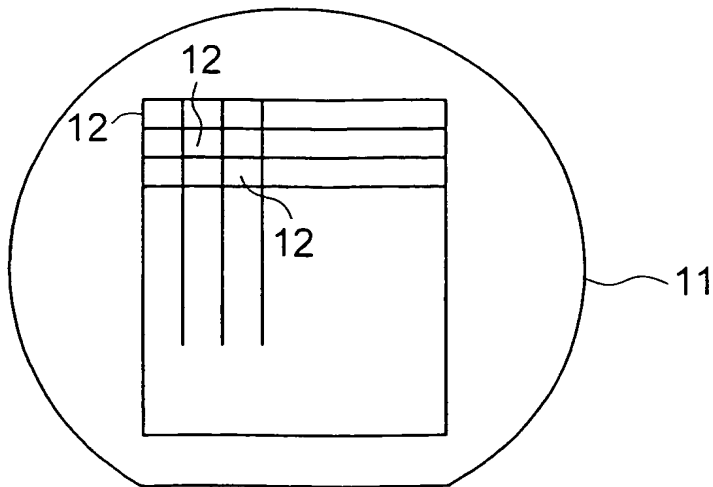


FIG. 3



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

FIG. 4 A

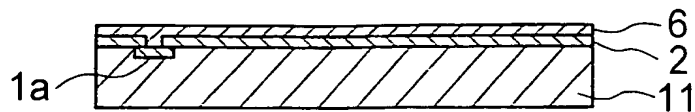


FIG. 4 B

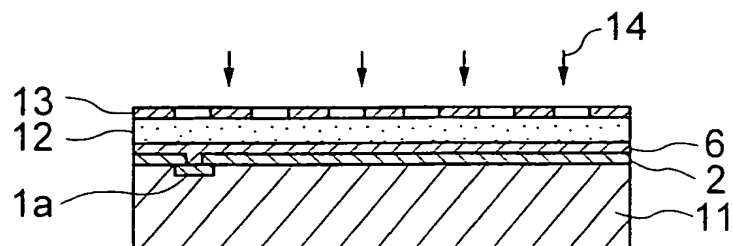


FIG. 4 C

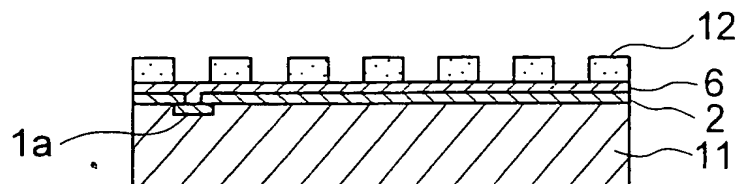


FIG. 4 D

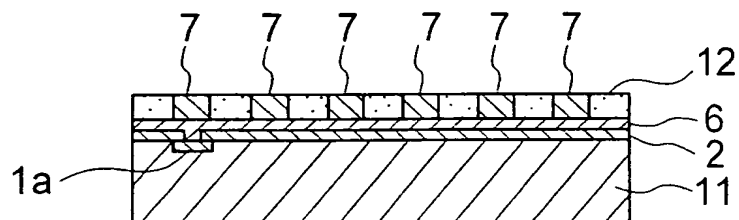


FIG. 4 E

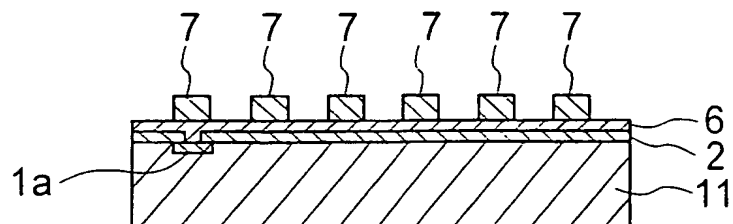
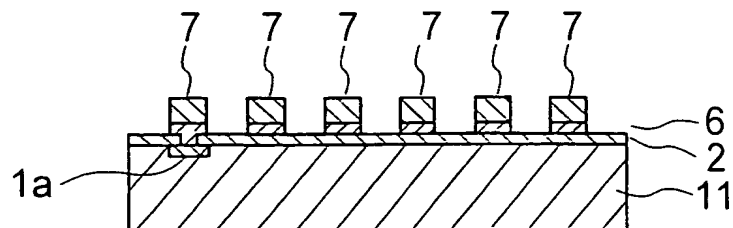


FIG. 4 F



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

FIG. 5 A

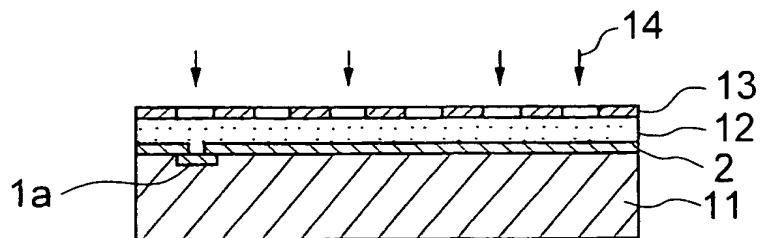


FIG. 5 B

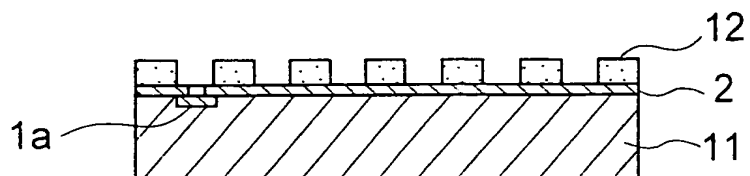


FIG. 5 C

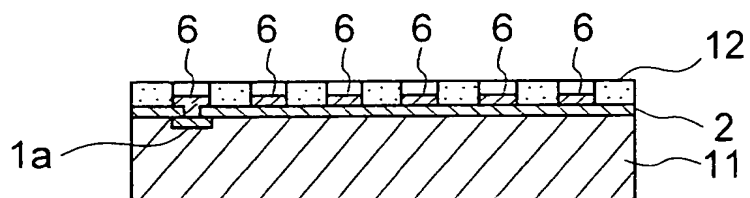


FIG. 5 D

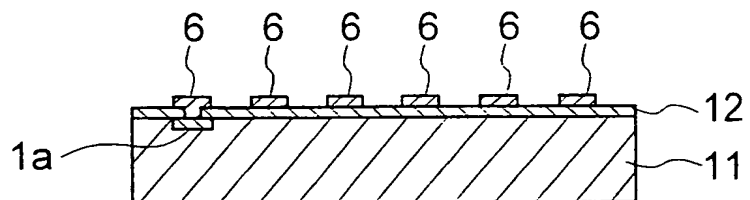
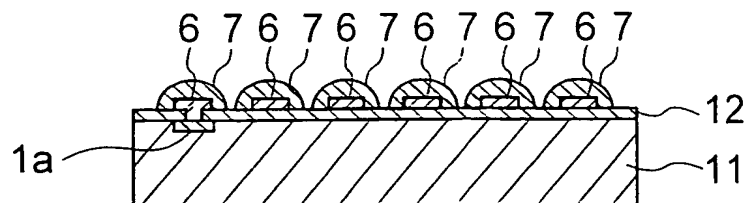
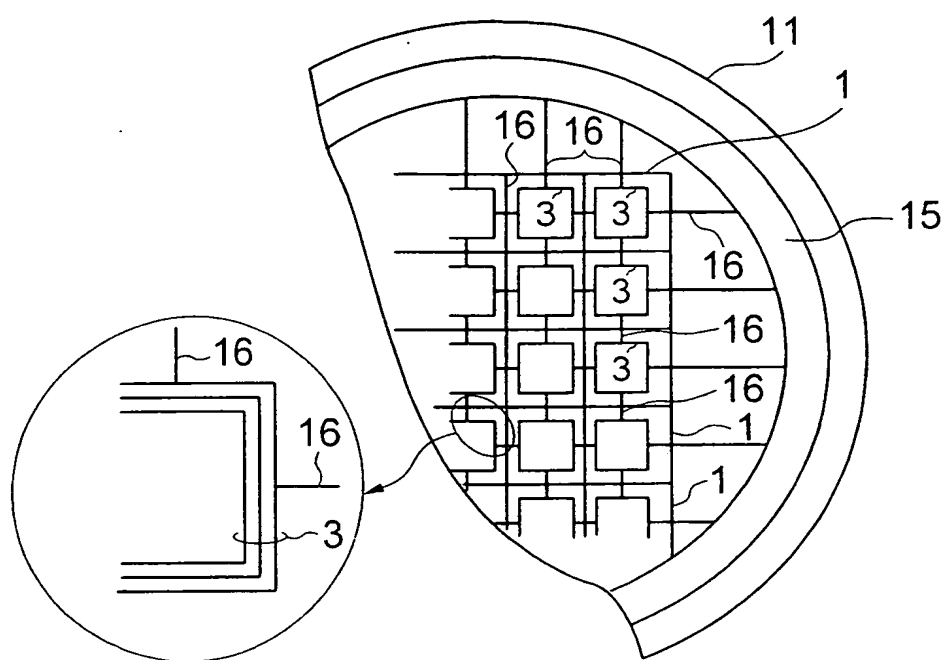


FIG. 5 E



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

FIG. 6



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

FIG. 7

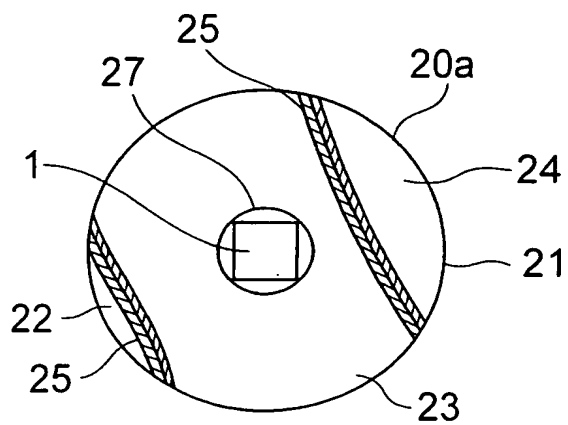


FIG. 8

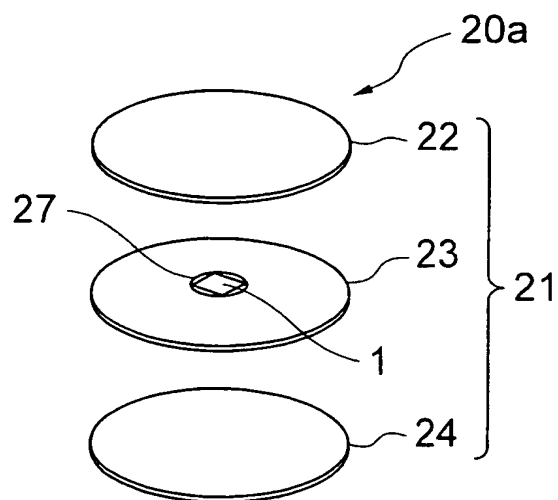
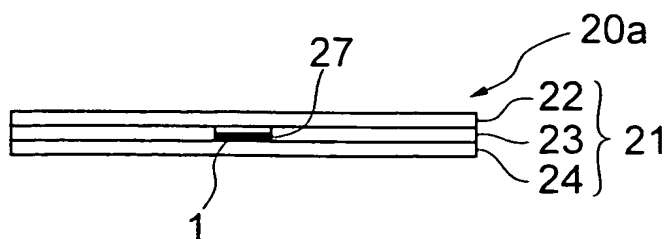


FIG. 9



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

7 / 10

FIG. 10

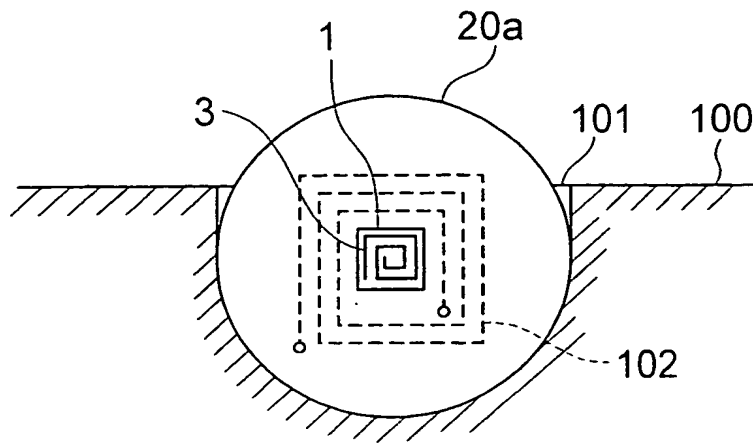


FIG. 11

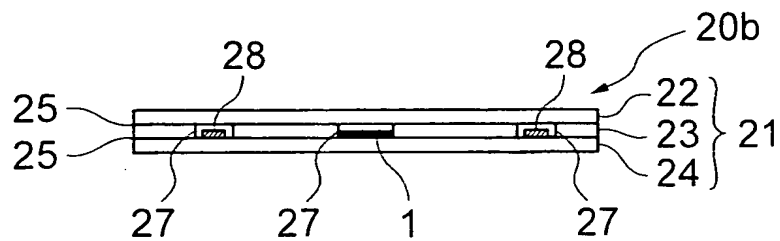


FIG. 12

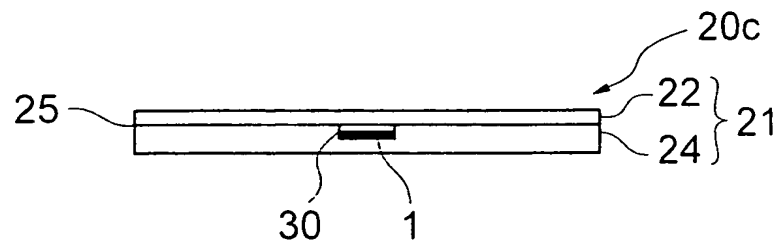
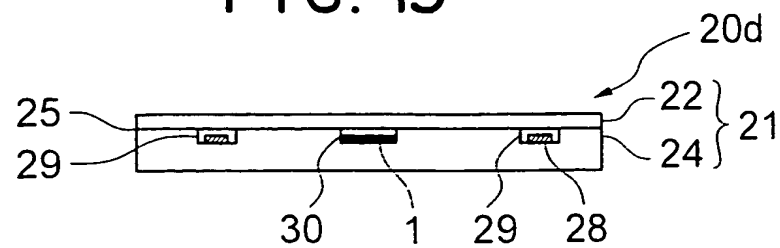


FIG. 13



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

8 / 10

FIG. 14

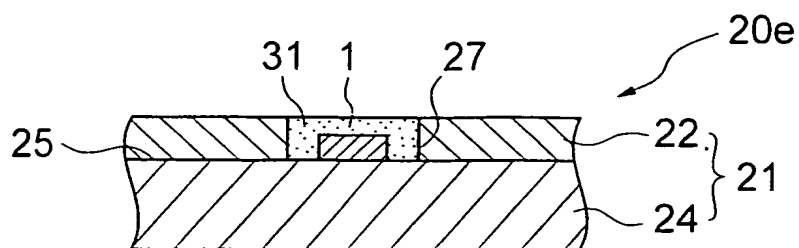


FIG. 15

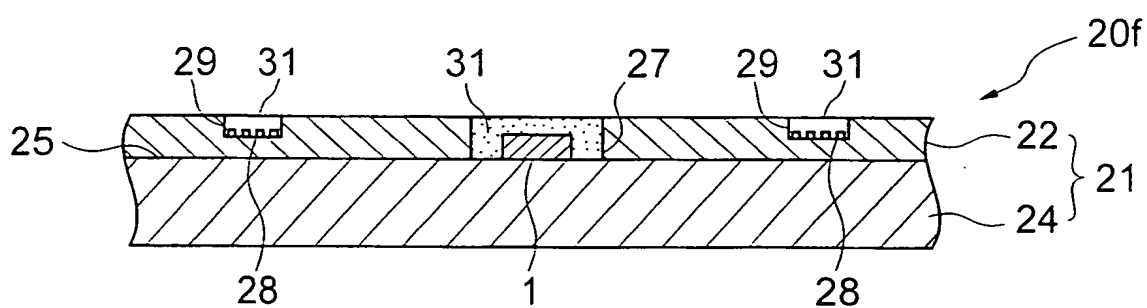


FIG. 16

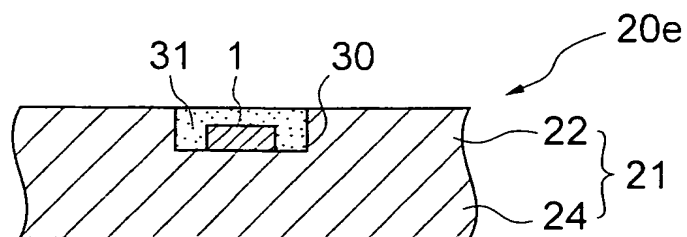
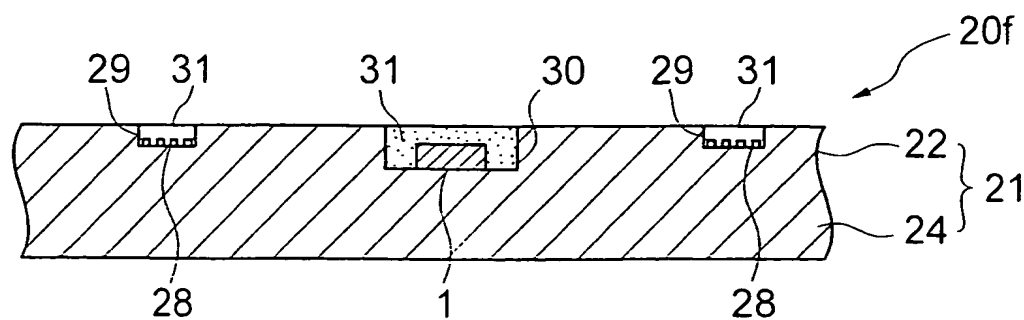


FIG. 17



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

FIG. 18

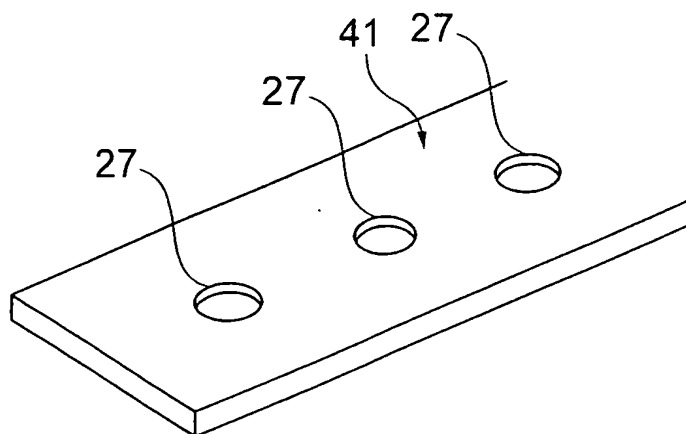
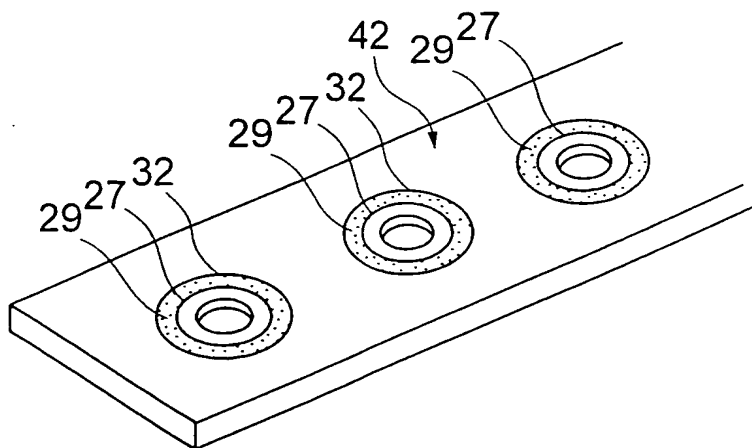


FIG. 19



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

10 / 10

FIG. 20

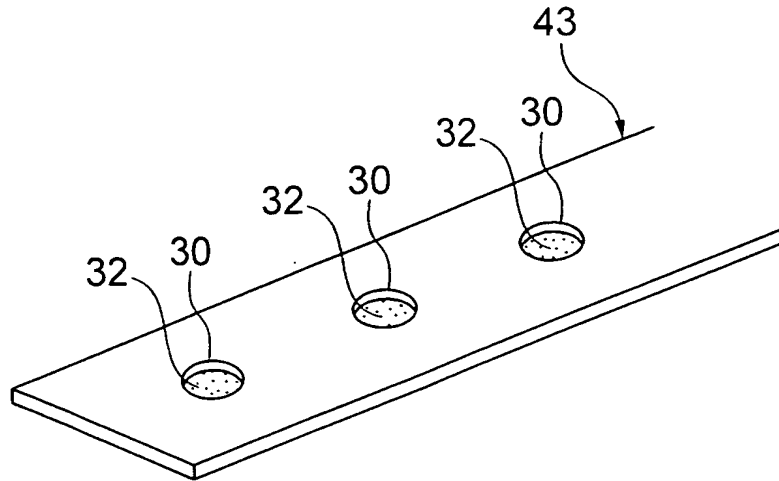


FIG. 21

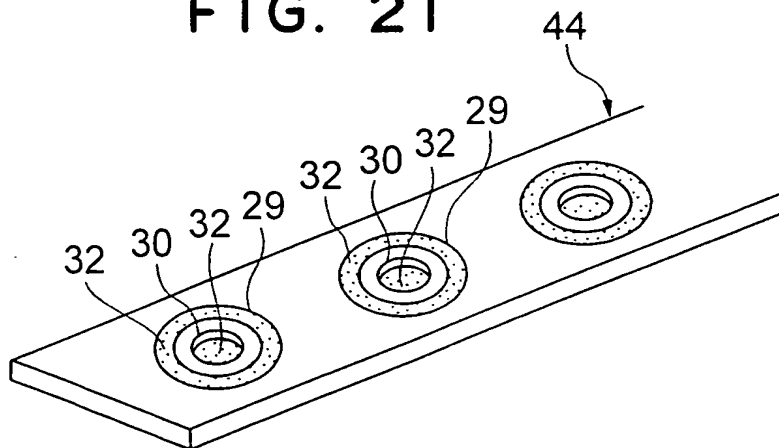
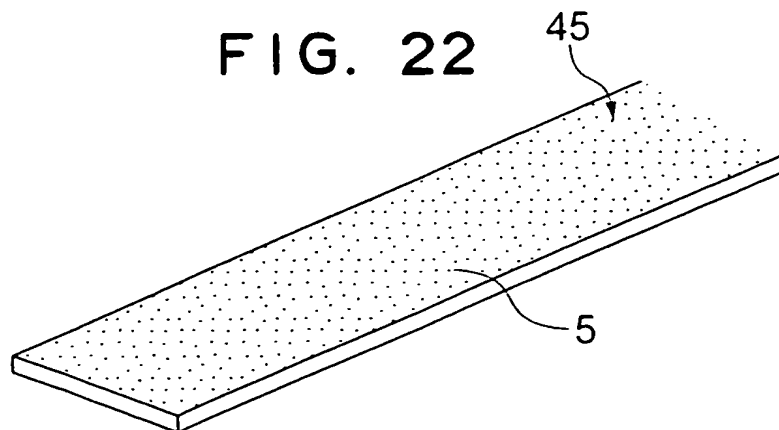


FIG. 22



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

PCT

EP



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)  
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 E 4 8 6 6 - 0 0	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/01029	国際出願日 (日.月.年) 23.02.00	優先日 (日.月.年) 24.02.99
出願人(氏名又は名称) 日立マクセル株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1A 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl<sup>7</sup> H01L25/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L25/00  
Int. Cl<sup>7</sup> B42D15/00  
Int. Cl<sup>7</sup> H01Q 1/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年  
日本国公開実用新案公報 1971-2000年  
日本国登録実用新案公報 1994-2000年  
日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 8-222695, A (株式会社日立製作所), 30. 8月. 1996 (30. 08. 96), 第3頁右欄第41行-第4頁左欄第49行, 第1図, 第5図 (ファミリーなし)	1-8
X	JP, 11-17443, A (京セラ株式会社), 22. 1月. 1999 (22. 01. 99), 第3頁, 第1-37行, 第1図, 第2図 (ファミリーなし)	9, 11, 12, 14, 15
Y		10, 13, 16-19

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

\* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献  
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 22. 05. 00

国際調査報告の発送日 30.05.00

国際調査機関の名称及びあて先  
日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号 100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
守安 太郎



4 R 9347

電話番号 03-3581-1101 内線 3470

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US, 5 8 5 6 6 6 2, A (Hitachi Maxell, Ltd.) 5. 1月. 1 9 9 9 (0 5. 0 1. 9 9) 全文, 第2図, 第27図 & JP, 9-2 7 5 1 8 4, A	10, 13, 16-19
Y	JP, 10-3 2 0 5 1 9, A (ローム株式会社), 4. 12月. 1998 (04. 12. 98), 全文, 第1図, 第8図 (ファミリーなし)	20-27
Y	JP, 10-3 0 2 0 4 0, A (株式会社東芝), 13. 11月. 1998 (13. 11. 98), 全文, 第1-7図 (ファミリーなし)	20-27
A	JP, 10-2 0 3 0 6 1, A (大日本印刷株式会社), 4. 8月. 1998 (04. 08. 98), 全文, 第1-6図 (ファミリーなし)	1-27

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

REC'D 27 APR 2001

WIPO PCT

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 E 4 8 6 6 - 0 0	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 0 0 / 0 1 0 2 9	国際出願日 (日.月.年) 2 3 . 0 2 . 0 0	優先日 (日.月.年) 2 4 . 0 2 . 9 9
国際特許分類 (IPC) I n t . C l <sup>7</sup> H 0 1 L 2 5 / 0 0		
出願人 (氏名又は名称) 日立マクセル株式会社		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で \_\_\_\_\_ ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  
I ☒ 国際予備審査報告の基礎  
II ☐ 優先権  
III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成  
IV ☐ 発明の単一性の欠如  
V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
VI ☐ ある種の引用文献  
VII ☐ 国際出願の不備  
VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 2 5 . 0 7 . 0 0	国際予備審査報告を作成した日 1 6 . 0 4 . 0 1	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 守安 太郎 印	4 R 9 3 4 7
電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 7 0		

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-27	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1-27	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-27	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP, 8-222695, A (株式会社日立製作所),  
30. 8月. 1996 (30. 08. 96),  
第3頁右欄第41行-第4頁左欄第49行, 第1図, 第5図  
(ファミリーなし)

文献2: JP, 11-17443, A (京セラ株式会社),  
22. 1月. 1999 (22. 01. 99),  
第3頁, 第1-37行, 第1図, 第2図 (ファミリーなし)

文献3: US, 5856662, A (Hitachi Maxell, Ltd.)  
5. 1月. 1999 (05. 01. 99) 全文, 第2図, 第27図  
& JP, 9-275184, A

文献4: JP, 10-320519, A (ローム株式会社),  
4. 12月. 1998 (04. 12. 98), 全文, 第1図, 第8図  
(ファミリーなし)

文献5: JP, 10-302040, A (株式会社東芝),  
13. 11月. 1998 (13. 11. 98), 全文, 第1-7図  
(ファミリーなし)

請求の範囲1-8

請求の範囲1-8に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-5に対して進歩性を有する。

文献1-5には「外部とのデータ通信を非接触で行うためのコイルが一体形成されたIC素子において、前記コイルを構成する導体を、金属スパッタ層又は金属蒸着層と金属めっき層とを有する多層構造にする点」が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

## 請求の範囲 9-19

請求の範囲 9-19 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1-5 に対して進歩性を有する。

文献 1-5 には「外部とのデータ通信を非接触で行うためのコイルが一体形成された IC 素子を基体に搭載してなる情報担体において、前記 IC 素子を、前記基体の平面方向の中心に配置する点」が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

## 請求の範囲 20-27

請求の範囲 20-27 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1-5 に対して進歩性を有する。

文献 1-5 には「コイルが一体形成された IC 素子を有する情報担体の製造方法において、多数の透孔が規則的に開設された第 1 帯状素材と透孔を有しない第 2 帯状素材を接合し、前記 IC 素子を前記透孔に収容し固定し、前記第 1 帯状素材と透孔を有しない第 3 帯状素材を接合し、接合された前記第 1 乃至第 3 の帯状素材から情報担体を打ち抜く点」が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**